

(11) Numéro de publication: 0 526 344 A1

# 12

## **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(21) Numéro de dépôt : 92402203.1

(22) Date de dépôt : 31.07.92

(51) Int. CI.<sup>5</sup>: **C03C 17/245**, C03C 17/00, C23C 16/40, C23C 16/44

(30) Priorité: 31.07.91 FR 9109717

Date de publication de la demande : 03.02.93 Bulletin 93/05

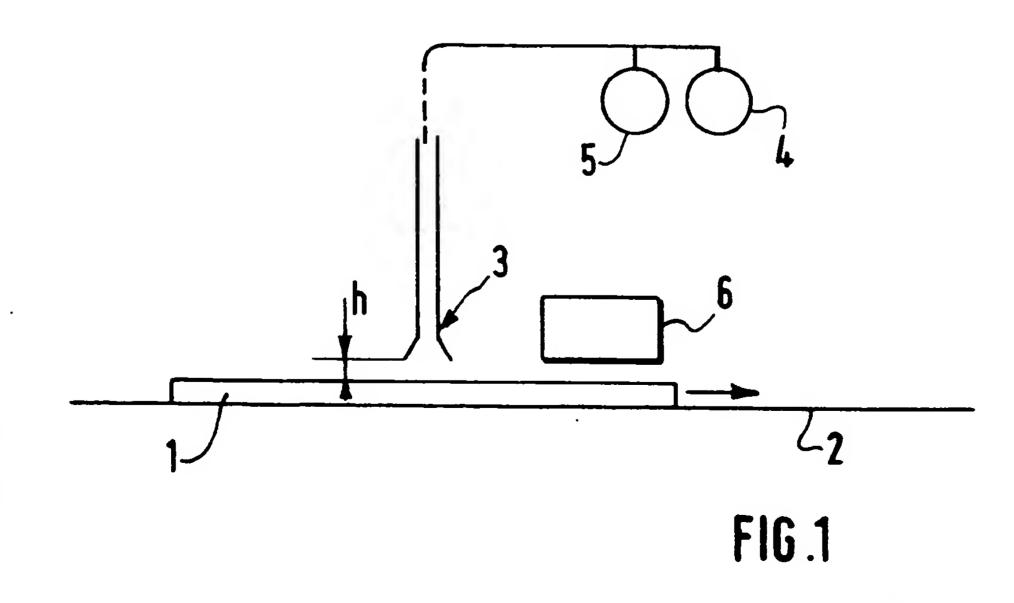
84 Etats contractants désignés : BE DE ES FR GB IT LU NL SE

71 Demandeur: L'AIR LIQUIDE, SOCIETE
ANONYME POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES
CLAUDE
75, Quai d'Orsay
F-75007 Paris (FR)

1 square Raphael
F-78150 Le Chesnay (FR)
Inventeur : Genies, Bernard
53 avenue de Beauséjour
F-91440 Bures sur Yvette (FR)
Inventeur : Ougarane, Lahcen
1 rue Jean Cocteau
F-78180 Montigny le Bretonneux (FR)
Inventeur : Recourt, Patrick
5 rue Toulouse-Lautrec
F-91460 Marcoussis (FR)

Mandataire: Le Moenner, Gabriel et al L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 (FR)

- (54) Procédé de formation d'un dépôt comprenant de la silice sur une surface d'un objet en verre.
- On forme un dépôt d'une couche à base de silice sur une surface d'un objet en verre (1) en projetant sur une surface chaude de l'objet, en atmosphère ambiante non confinée, un mélange gazeux ayant une teneur en silane inférieure à 2 %, une teneur en oxygène comprise entre 3,5 et 30 %, et avantageusement une teneur en hydrogène inférieure à 5 %. La surface de l'objet à traiter est avantageusement chauffée (6) juste avant son passage au poste d'injection.



EP 0 526 344 A1

Jouve, 18, rue Saint-Denis, 75001 PARIS

CEST AVAILABLE COPY

La présente invention concerne les procédés de formation d'un dépôt comprenant de la silice sur une surface d'un objet en verre par projection d'un mélange gazeux comprenant un gaz neutre majoritaire, un précurseur du silicium et de l'oxygène sur la surface chaude de l'objet au moyen d'au moins une buse de projection.

Un procédé de ce type est connu du document US-A-3.717.498 où la projection est effectuée de façon confinée dans un tube. Plus récemment, le document GB-A-2.234.264 décrit un procédé similaire, pour du verre plat, où l'injection s'effectue dans une chambre de revêtement recouvrant la zone à revêtir et elle-même enclose dans une hotte aspirante munie de jupes d'étanchéité.

La présente invention a pour objet de proposer un procédé du type ci-dessus, convenant notamment pour la formation sur la surface d'un objet en verre, notamment sodo-calcique ou fluorosilicate, de couches barrières anti-migration, en particulier de sodium sur les verres sodo-calciques, et pour l'augmentation de la résistance de l'objet en verre aux milieux alcalins, notamment aux produits détergents, permettant d'effectuer de façon simple et particulièrement souple des dépôts de qualité sur un grand nombre d'objets en verre, et autorisant de ce fait des coûts d'installation et de production notablement réduits.

Pour ce faire, selon une caractéristique de l'invention, la projection est effectuée sur la surface chaude de l'objet en verre en atmosphère ambiante non confinée, typiquement à l'air libre.

Selon une caractéristique plus particulière de l'invention, la teneur en précurseur du silicium, typiquement un silane, dans le mélange gazeux est comprise entre 0,5 et 2 %, typiquement d'environ 1 %, la teneur en oxygène dans le mélange gazeux étant comprise entre 3,5 et 30 %, typiquement entre 7 et 15 %.

Selon une autre caractéristique de l'invention, on adjoint au mélange gazeux à projeter de l'hydrogène, à une teneur typiquement inférieure à 5 %.

Selon des caractéristiques plus particulières de l'invention, la teneur en hydrogène dans le mélange gazeux est compris entre 0,1 et 5 %, typiquement supérieure à 2 % et avantageusement d'environ 3 %, la teneur en précurseur du silicium, typiquement un silane, avantageusement le monosilane, étant comprise entre 0,1 et 2 %, avantageusement d'environ 1 %, la teneur en oxygène dans le mélange gazeux étant comprise entre 3,5 et 30 %, le rapport volumique entre l'oxygène et le précurseur de silicium étant de préférence compris entre 5 et 20, typiquement supérieur à 7, le rapport volumique entre l'hydrogène et le silane étant de préférence supérieur à 2, typiquement d'environ 3.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la surface de verre à traiter est chauffée sélectivement juste avant la projection du mélange gazeux, à l'air libre, sur la surface chauffée.

La Demanderesse a constaté que, de façon surprenante, dans les conditions sus-mentionnées, par la projection à l'air libre du mélange gazeux sur la surface de verre chaude (à une température comprise entre environ 300° et la température de formage du verre), on obtenait le dépôt d'une couche homogène, uniforme, non granulaire et stoechiométrique de silice ou de silice hydrogénée sans qu'il y ait de redéposition notable sur cette couche de particules isolées contenant de la silice.

La présente invention sera mieux comprise au vu de la description suivante de modes de réalisation, donnée à titre illustratif mais nullement limitatif, faite en relation avec les dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique d'un premier mode de réalisation d'une installation pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention ; et
- les figures 2 et 3 sont des vues schématiques d'autres modes de réalisation de l'invention.

On a représenté schématiquement sur la figure 1 une plaque de verre 1 acheminée à l'air libre sur une bande transporteuse 2 sur le trajet de laquelle est disposée une buse 3 de projection d'un mélange ternaire silane-oxygène-azote pour la formation, sur la surface supérieure de la plaque 1, d'une couche de silice. Dans ce mode de réalisation, la buse 3 définit une fente de projection transversale à la direction d'avancement relatif de la plaque 1 et est alimentée en mélange ternaire à partir d'un réservoir 4 contenant un mélange binaire d'azote et de silane et d'un réservoir 5 d'oxygène gazeux. La buse de projection 3 peut être disposée directement en aval d'un four de flottage d'où la plaque de verre 1 sort à la température requise. Le poste de projection peut être toutefois prévu indépendamment de tout four, auquel cas, typiquement, un poste de chauffe 6, par exemple à infrarouges, sera disposé juste en amont du poste de projection dans le sens de défilement de la plaque 1.

Dans ce mode de réalisation, la distance <u>h</u> entre l'extrémité de la buse 3 et la surface à revêtir de la plaque 1 est inférieure à 15 mm, et comprise typiquement entre 3 et 10 mm, la vitesse d'éjection du mélange étant comprise entre 5 et 30 m/seconde, selon la largeur de la fente.

La teneur en silane dans le mélange gazeux est comprise entre 0,5 et 2 %, de préférence entre 0,8 et 1 %, la teneur en oxygène dans le mélange gazeux étant comprise entre 3,5 et 30 %, de préférence entre 7 et 15 %, le rapport volumique oxygène/silane étant compris entre 5 et 30, typiquement entre 7 et 15, de préférence entre 7 et 10.

Dans ces conditions, avec une vitesse de défilement relative entre la plaque et la buse de 5 cm/seconde et un nombre de passages successifs correspondant à un temps d'injection réel sur une zone élémentaire de

5

15

20

30

35

40

la plaque portée à une température entre 550°C et 600°C, d'environ 9 secondes, on obtient une couche de silice stoechiométrique d'épaisseur uniforme d'environ 0,7 um présentant un nombre de particules non liées redéposées d'une dimension ne dépassant pas 0,2 um inférieur à 10/mm². Des résultats similaires sont obtenus avec, au lieu d'azote, de l'argon qui permet de réduire légèrement la durée de projection du mélange gazeux pour l'obtention d'une couche barrière efficace. Un test de résistance aux milieux alcalins (attaque alcaline, pendant 15 minutes, d'une solution bouillante de 0,5 mole/ litre de Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> et d'une mole/litre de NaOH, suivie d'une deuxième attaque de 15 minutes, avec une même solution bouillante) et mesure des intensités de fluorescence X révèle une résistance de la couche de silice à l'attaque basique non inférieure à 30 minutes.

Suivant un autre aspect de l'invention, on ajoute au mélange gazeux de gaz neutre, de silane et d'oxygène, entre 0,1 et 5 % d'hydrogène sans modifier sensiblement les conditions opératoires si ce n'est que le mélange gazeux contenant l'hydrogène est maintenu, jusqu'à son éjection, à une température inférieure à 200°C, typiquement inférieure à 150°C, et est projeté à l'air libre sur la surface à traiter pendant au moins 2 secondes, typiquement entre 5 et 20 secondes selon la géométrie et la finalité de l'objet en verre. La surface du verre à traiter est, ici également, préalablement chauffée à une température entre 300°C et la température de formage du verre ou du cristal, typiquement à une température entre 500 et 600°C.

Le mélange gazeux est constitué majoritairement d'un gaz neutre diluant, tel que l'azote ou l'argon. Le précurseur gazeux du silicium est avantageusement un silane, tel que le monosilane, le disilane ou le trisilane. La teneur en silane dans le mélange gazeux varie entre 0,1 % et la limite inférieure d'inflammabilité du silane selon les autres constituants du mélange gazeux, par exemple 3 % dans le cas de monosilane avec de l'azote comme gaz diluant. La teneur en oxygène est comprise entre 3,5 et 30 %. La teneur en hydrogène varie entre 0,1 % et la limite inférieure d'inflammabilité de l'hydrogène dans les conditions du procédé.

Le tableau ci-dessous montre les performances de la résistance hydrolytique de dépôts de couches à base de silice ou de silice hydrogénée obtenus selon l'invention dans différentes conditions opératoires. Le test appliqué est le suivant : un flacon en verre sodo-calcique, dans lequel a été injecté un mélange gazeux selon l'invention pour y former une couche à base de silice, est rempli d'eau distillée, puis est porté à 80°C pendant 48 heures. On dose ensuite le sodium extrait du verre, par exemple par spectrométrie de flamme.

Migration du sodium en ug/ml :				
Temps de traitement	5s	15s		
Témoin non traité	8	8		
Traitement A	4	-		
Traitement B	2,58	0,5		
Traitement C	2,32	0,1		

### Conditions opératoires :

- température du verre : 570°C

- débit du mélange gazeux : 100 l/h

- traitement A : SiH4 : 1 %, 02 : 7 % N2 : 92 %

- traitement B : SiH4 : 1 %, 02 : 7 %, H2 : 3 %, N2 : 89 %

- traitement C : SiH4 : 1 %, 02 : 16 %, H2 : 3 %, N2 : 80 %

On notera que, par rapport au traitement A, qui correspond au procédé sans hydrogène décrit ci-dessus, qui divisait déjà par deux la-quantité de sodium migrant par rapport à un témoin non traité, le procédé mettant en oeuvre de l'hydrogène permet de diviser cette quantité par plus de trois, avec un temps de traitement de 5 secondes et par plus de 15, avec un temps de traitement de 15 secondes.

La grande simplicité du procédé selon l'invention, permettant d'effectuer des dépôts à l'air libre, autorise un grand nombre d'applications à des objets en verre de formes diverses, avec des épaisseurs de couche variables selon le temps et la vitesse d'injection du mélange gazeux, la teneur en silane, en oxygène et en hydrogène du mélange, et la température de la surface à traiter.

On a représenté sur la figure 2 l'application du procédé au revêtement de la surface interne d'une soucoupe

10

30

35

40

45

ou d'une assiette 1' sortant d'un four de réchauffe 60. Dans ce mode de réalisation, la buse d'injection 3' est conformée à la façon d'un tore comportant une fente d'injection circulaire 30 de diamètre adapté à celui de la soucoupe 1', la buse 3' étant abaissée au-dessus de la soucoupe 1' à sa sortie du four 60, de formage ou de réchauffe, et accompagnant le déplacement de cette dernière pendant une durée comprise entre 3 et 20 secondes, selon l'épaisseur de couche de dépôt désirée. La buse peut également présenter une surface d'éjection poreuse de dimension et de forme correspondant étroitement à celles de l'objet à traiter. Les mêmes mélanges gazeux que précédemment sont utilisés.

Dans le mode de réalisation de la figure 3, l'objet en verre à revêtir est ici constitué d'un flacon 1" qui, encore chaud, est placé sur un support tournant 20. Une première buse cylindrique 3", est introduite dans le col du flacon 1" tandis qu'une seconde buse 3", présentant une fente d'éjection parallèle à une génératrice du flacon 1" est disposée au voisinage de la paroi externe de ce dernier. Les mêmes mélanges gazeux que précédemment sont éjectés par les deux buses 3", et 3", le temps d'injection à l'intérieur du flacon étant compris entre 3 et 5 secondes, ce qui permet une intégration aisée dans une chaîne de production industrielle.

Quoique la présente invention ait été décrite en relation avec des modes de réalisation particuliers, elle ne s'en trouve pas limitée pour autant mais est au contraire susceptible de modifications et de variantes qui apparaîtront à l'homme de l'art.

#### Revendications

20

15

1. Procédé de formation d'un dépôt de silice sur une surface d'un objet en verre (1,1',1") par projection d'un mélange gazeux comprenant un gaz neutre majoritaire, un précurseur du silicium et de l'oxygène sur la surface chaude de l'objet en verre au moyen d'au moins une buse de projection (3;3';3"1,3"2), caractérisé en ce que la projection est effectuée sur la surface chaude en atmosphère ambiante non confinée.

- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on chauffe sélectivement (6) au moins la surface à traiter de l'objet en verre juste avant la projection du mélange gazeux.
- 3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la buse (3;3';3"<sub>1</sub>,3"<sub>2</sub>) est animée d'un mouvement relatif par rapport à la surface à traiter.
  - 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la buse comporte au moins un orifice d'éjection adapté à la géométrie de la surface à traiter.
- 5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la distance (h) entre la buse (3;3';3"<sub>2</sub>) et la surface à traiter est inférieure à 15 mm.
  - 6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la distance (h) est comprise entre 3 et 10 mm.
- 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la vitesse d'éjection du mélange est comprise entre 5 et 30 m/s.
  - 8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le précurseur du silicium est un silane dont la teneur dans le mélange gazeux est comprise entre 0,5 et 2 % environ.
- 9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que la teneur en silane est d'environ 1 %.
  - 10. Procédé selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que la teneur en oxygène dans le mélange gazeux est comprise entre 3,5 et 30 % environ.
- 11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que la teneur en oxygène est comprise entre 7 et 15 % environ.
  - 12. Procédé selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que le rapport volumique entre l'oxygène et le silane dans le mélange gazeux est d'environ 7.
- 13. Procédé selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte l'étape d'adjoindre de l'hydrogène au mélange gazeux à projeter.
  - 14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que la teneur en hydrogène dans le mélange gazeux

est comprise entre 0,1 et 5 %.

5

15

- 15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce que la teneur en précurseur du silicium dans le mélange gazeux est comprise entre 0,1 % et 2 % environ.
- 16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que la teneur en oxygène dans le mélange gazeux est comprise entre 3,5 et 30 % environ.
- 17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce que le rapport volumique, dans le mélange gazeux, entre l'oxygène et le précurseur du silicium est compris entre 5 et 20.
  - 18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que le précurseur du silicium est un silane.
  - 19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en ce que la teneur en silane dans le mélange gazeux est d'environ 1 %.
  - 20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en ce que le rapport volumique, dans le mélange gazeux, entre l'hydrogène et le silane est supérieur à 2.
- 21. Procédé selon la revendication 19 ou la revendication 20, caractérisé en ce que le rapport volumique, dans le mélange gazeux, entre l'oxygène et le silane est supérieur à 7.
  - 22. Procédé selon l'une des revendications 19 à 21, caractérisé en ce que la teneur en hydrogène dans le mélange gazeux est d'environ 3 %.
- 23. Procédé selon l'une des revendications 13 à 22, caractérisé en ce que la température du mélange gazeux est maintenue inférieure à 200°C jusqu'à son éjection.
  - 24. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mélange gazeux est projeté sur la surface de l'objet en verre pendant au moins 2 secondes.
- 25. Procédé selon la revendication 24, caractérisé en ce que le mélange gazeux est projeté sur la surface pendant une durée comprise entre environ 5 et 20 secondes.
  - 26. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le gaz neutre est l'azote.
- 27. Procédé selon l'une des revendications 1 à 25, caractérisé en ce que le gaz neutre est l'argon.

40

45

*50* 

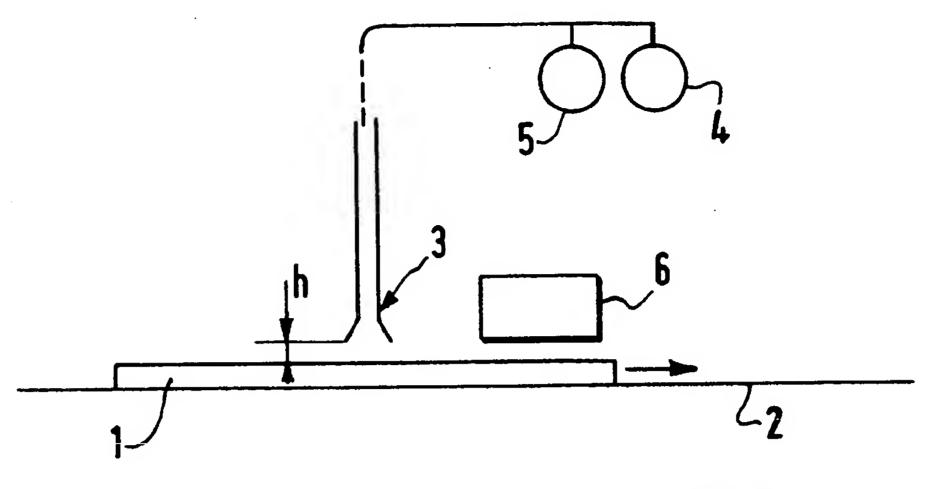
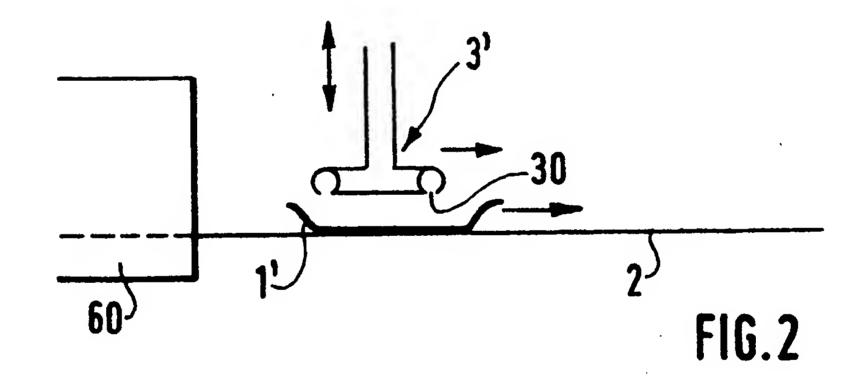
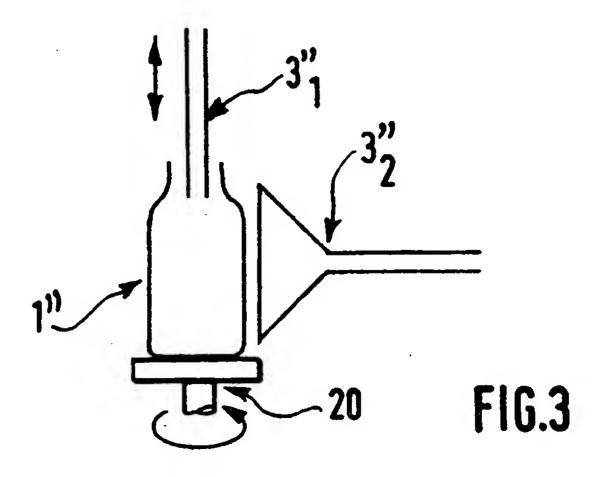


FIG.1







# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 92 40 2203

atégorie	Citation du document avec i	ndication, en cas de besoin,	Revendication	CLASSEMENT DE LA	
	des parties per		concernée	DEMANDE (lut. Cl.5)	
A	EP-A-0 213 045 (SAI	NT-GOBAIN VITRAGE)	1-27	C03C17/245	
	* page 4, ligne 18	- page 6, ligne 30;		C03C17/00	
	revendications *			C23C16/40	
	PATENT ABSTRACTS OF	.1ADAN	١,	C23C16/44	
	vol. 2, no. 93 (C-1		1		
	& JP-A-53 054 181 (	FUJITSU K.K. ) 17 Mai			
	1978	1001.00 K.K. ) 17 Mai			
	* abrégé *				
A	PATENT ABSTRACTS OF	TADAN	1		
``	vol. 13, no. 384 (C		1		
	1989	023)(3/32) 24 AUGC			
		NEC CORP. ) 25 Mai 1989			
	* abrégé *				
				DOMAINES TECHNIQUES	
				RECHERCHES (Int. Cl.5)	
				CO3C	
				C23C	
·				C04B	
			1		
į					
			1		
			}		
]					
<u> </u>			_		
Le pr	ésent rapport a été établi pour to	ates les revendications			
	LA HAYE	Date d'achivement de la recherche		Exercises	
<del></del>		27 OCTOBRE 1992		VAN BOMMEL L.	
	CATEGORIE DES DOCUMENTS		cipe à la base de l'	invention	
X : par	ticulièrement pertinent à lui seul	u après cette date	vet antérieur, mais publié à la après cette date		
2111	particulierement pertinent en combinaison avec un D : cité dans la demande autre document de la même catégorie				
A : 277	ière-plan technologique				

THIS PAGE BLANK (USPTO)